

レーザー学会東京支部 第10回 先進レーザー応用技術セミナー
「産業界に広がる先端レーザープロセッシング」
 開催のご案内

主催： (社) レーザー学会東京支部

開催日時： 2008年10月3日(金) 13:00-17:10 (セミナー終了後、懇親会を開催いたします)

会場： (独) 産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館 バイオ・IT融合研究棟11階 第1会議室
 (http://unit.aist.go.jp/waterfront/jp/access_map/index.html)

対象： 中堅技術者や新任開発リーダーから若手研究者学生の方まで歓迎いたします

趣旨： レーザープロセッシングの産業応用における最前線研究の現状および将来展望について
 講義・議論いたします

プログラム：

13:00-13:05 レーザー学会東京支部長挨拶

小原 實 (慶應義塾大学)

13:05-13:15 企画説明

担当支部委員

13:15-13:50 第1講 積層型薄膜シリコン太陽電池におけるレーザーパターニング

篠原 亘 (三洋電機)

13:50-14:25 第2講 シリコン薄膜型太陽電池製造工程におけるレーザー加工の紹介

太田 信久 (カネカ)

14:25-15:00 第3講 構造物の寿命を伸ばすレーザーピーニング

佐野 雄二 (東芝)

15:00-15:25 休憩

15:25-16:00 第4講 リソグラフィ用エキシマレーザー・EUV光源の開発の現状

溝口 計 (ギガフォトン)

16:00-16:35 第5講 高出力レーザーの半導体プロセスへの応用

河口 紀仁 (IHI)

16:35-17:10 第6講 レーザーダイシング技術と加工現象の観察

高橋 邦充 (ディスコ)

17:30- 懇親会 (11F ホワイエ)

参加費：テキスト代込み

一般会員5000円, 一般非会員9000円
 学生会員2000円, 学生非会員4000円
 (テキスト追加分は2000円)

懇親会 3000円

参加申込：当日会場で受付いたします

交通のご案内

新交通ゆりかもめ テレコムセンター駅(徒歩約4分)
 東京臨海高速鉄道りんかい線 東京テレポート駅(徒歩15分またはバス)

お問い合わせ先

伊澤 淳 (IHI)
 TEL: 045-759-2819
 FAX: 045-759-2207
 E-mail: jun_izawa@ihi.co.jp

